



检 测 报 告

TEST REPORT

报告编号: KDHJ251310-1

检测类别:	委托检测
项目名称:	废气检测
委托单位:	无锡华润上华科技有限公司

江苏康达检测技术股份有限公司
KANG DA TESTING TECHNOLOGY (JIANG SU) Co., Ltd.



声 明

一、本报告加盖本公司检验检测专用章及骑缝章后生效；本报告无编制、审核、签发者签名无效。

二、本检测报告只对所检样品的检测结果负责；对委托单位自行采集的样品，本公司仅对送检样品负责。

三、用户对本报告若有异议，可在收到本报告后 15 日内，向本公司书面提出异议，逾期不提出，则视为认可本报告。

四、未经本公司书面批准，不得以任何形式复制（全文复制除外）本报告；任何对本报告的涂改、伪造、变更及不当使用均无效，其责任人将承担相关法律及经济责任，本公司保留对上述行为追究法律责任的权利。

五、除客户特别申明并支付样品保管费外，超过合同约定保存时间或标准规定时效的样品均不再保留。

六、本公司对本报告的检测数据保守秘密；除客户特别申明并支付档案管理费或法律规定的特殊要求外，本次已存档的检测报告保存期限为 6 年。

地 址：中国 江苏省 苏州市 苏州工业园区 长阳街 259 号钟园工业坊 3、4 栋

邮政编码：215000

电 话：0512-65733680

电子邮件：zyf@ehscare.org

检测报告

委托单位	无锡华润上华科技有限公司		
通讯地址	江苏省无锡市新吴区锡士路		
联系人	高扬	联系电话	13961774334
采样日期	2025-02-20~2025-02-21、 2025-02-25~2025-02-27	分析日期	2025-02-20~2025-03-03
检测目的	为客户了解污染物排放情况提供检测数据。		
检测结论	检测结果见表1。		
<div>编制：丁玉清</div> <div>审核：黄凯华</div> <div>签发：邵娇娇</div> <div>检测机构检验章</div> <div>签发日期：2025 年 03 月 12 日</div> <div></div>			

表 1-1 固定污染源废气检测结果表（2 月 20 日）

点位名称		FQ-010 废气排气筒		排气筒高度（m）		33.5
净化设施		碱喷淋				
检测项目		第一批次	第二批次	第三批次	均值	排放限值
烟气温度（℃）		17.5	17.5	17.5	17.5	/
标态烟气量（Nm³/h）		32807	33463	33885	33385	/
硫酸雾	排放浓度(mg/m³)	ND	ND	ND	ND	5.0
	排放速率（kg/h）	/				/
备注	1、排气筒高度由受检单位提供。 2、排放限值：《半导体行业污染物排放标准》（DB32/3747-2020）表 3 限值。 3、“ND”表示未检出，硫酸雾的检出限为 0.2mg/m³（采样体积以 400L 计）。					

表 1-2 固定污染源废气检测结果表（2 月 20 日）

点位名称		FQ-010 废气排气筒		排气筒高度（m）		33.5
净化设施		碱喷淋				
检测项目		第一批次	第二批次	第三批次	均值	排放限值
烟气温度（℃）		17.5	17.5	17.1	17.4	/
标态烟气量（Nm³/h）		34282	33696	34774	34251	/
氟化物	排放浓度(mg/m³)	ND	ND	ND	ND	1.5
	排放速率（kg/h）	/				/
氮氧化物	排放浓度(mg/m³)	ND	ND	ND	ND	50
	排放速率（kg/h）	/				/
备注	1、排气筒高度由受检单位提供。 2、排放限值：《半导体行业污染物排放标准》（DB32/3747-2020）表 3 限值。 3、“ND”表示未检出，氟化物的检出限为 0.06mg/m³（采样体积以 150L 计），氮氧化物的检出限为 3mg/m³。					

表 1-3 固定污染源废气检测结果表（2 月 20 日）

点位名称		FQ-010 废气排气筒		排气筒高度（m）		33.5
净化设施		碱喷淋				
检测项目		第一批次	第二批次	第三批次	均值	排放限值
烟气温度（℃）		17.5	17.5	17.5	17.5	/
标态烟气量（Nm³/h）		32807	33463	33463	33244	/
氯化氢	排放浓度（mg/m³）	0.40	0.43	0.42	0.42	10
	排放速率（kg/h）	0.014				/
备注	1、排气筒高度由受检单位提供。 2、排放限值：《半导体行业污染物排放标准》（DB32/3747-2020）表 3 限值。					

表 1-4 固定污染源废气检测结果表（2 月 20 日）

点位名称		FQ-010 废气排气筒		排气筒高度（m）		33.5
净化设施		碱喷淋				
检测项目		第一批次	第二批次	第三批次	均值	排放限值
烟气温度（℃）		17.5	17.5	17.1	17.4	/
标态烟气量（Nm³/h）		32807	33885	34774	33822	/
氯气	排放浓度(mg/m³)	ND	ND	ND	ND	5.0
	排放速率（kg/h）	/				/
备注	1、排气筒高度由受检单位提供。 2、排放限值：《半导体行业污染物排放标准》（DB32/3747-2020）表 3 限值。 3、“ND”表示未检出，氯气的检出限为 0.2mg/m³（采样体积以 5L 计）。 4、氯气均值为三小时均值。					

表 1-5 固定污染源废气检测结果表（2 月 20 日）

点位名称		FQ-016 废气排气筒		排气筒高度（m）		33.5
净化设施		酸喷淋				
检测项目		第一批次	第二批次	第三批次	均值	排放限值
烟气温度（℃）		15.4	15.2	15.1	15.2	/
标态烟气量（Nm³/h）		18994	19314	19382	19230	/
氨	排放浓度(mg/m³)	ND	ND	ND	ND	10
	排放速率（kg/h）	/				/
备注	1、排放限值：《半导体行业污染物排放标准》（DB32/3747-2020）表 3 限值。 2、“ND”表示未检出，氨的检出限为 0.25mg/m³（采样体积以 10L 计）。 3、排气筒高度由受检单位提供。					

表 1-6 固定污染源废气检测结果表（2 月 20 日）

点位名称		FQ-017 废气排气筒		排气筒高度（m）		33.5
净化设施		酸喷淋				
检测项目		第一批次	第二批次	第三批次	均值	排放限值
烟气温度（℃）		14.9	14.8	14.8	14.8	/
标态烟气量（Nm³/h）		19441	19712	19593	19582	/
氨	排放浓度(mg/m³)	ND	ND	ND	ND	10
	排放速率（kg/h）	/				/
备注	1、排放限值：《半导体行业污染物排放标准》（DB32/3747-2020）表 3 限值。 2、“ND”表示未检出，氨的检出限为 0.25mg/m³（采样体积以 10L 计）。 3、排气筒高度由受检单位提供。					

表 1-7 固定污染源废气检测结果表（2 月 20 日）

点位名称		FQ-051 废气排气筒		排气筒高度（m）		33.5
净化设施		活性炭吸附				
检测项目		第一批次	第二批次	第三批次	均值	排放限值
烟气温度（℃）		13.8	14.0	14.3	14.0	/
标态烟气量（Nm³/h）		2437	2368	2433	2413	/
氨	排放浓度(mg/m³)	ND	ND	ND	ND	10
	排放速率（kg/h）	/				/
备注	1、排放限值：《半导体行业污染物排放标准》（DB32/3747-2020）表 3 限值。 2、“ND”表示未检出，氨的检出限为 0.25mg/m³（采样体积以 10L 计）。 3、排气筒高度由受检单位提供。					

表 1-8 固定污染源废气检测结果表（2 月 20 日）

点位名称		FQ-051 废气排气筒		排气筒高度（m）		33.5
净化设施		活性炭吸附				
检测项目		第一批次	第二批次	第三批次	最大值	排放限值
烟气温度（℃）		13.8	14.5	13.0	/	/
标态烟气量（Nm³/h）		2437	2429	2369	/	/
硫化氢	排放浓度(mg/m³)	ND	ND	ND	/	/
	排放量（kg/h）	/	/	/	/	1.8
臭气浓度	无量纲	26	30	35	35	15000
备注	1、排放限值：《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-1993）表 2 限值。 2、“ND”表示未检出，硫化氢的检出限为 0.008mg/m³（采样体积以 9L 计）。 3、排气筒高度由受检单位提供。					

表 1-9 固定污染源废气检测结果表（2 月 20 日）

点位名称		FQ-050 废气排气筒		排气筒高度（m）		33.5
净化设施		酸喷淋				
检测项目		第一批次	第二批次	第三批次	均值	排放限值
烟气温度（℃）		14.2	14.7	14.1	14.3	/
标态烟气量（Nm³/h）		2186	2145	2145	2159	/
氨	排放浓度(mg/m³)	1.05	0.70	0.80	0.85	10
	排放速率（kg/h）	1.8×10 ⁻³				/
备注	1、排放限值：《半导体行业污染物排放标准》（DB32/3747-2020）表 3 限值。 2、排气筒高度由受检单位提供。					

表 1-10 固定污染源废气检测结果表（2 月 20 日）

点位名称		FQ-049 废气排气筒		排气筒高度（m）		33.5
净化设施		碱喷淋				
检测项目		第一批次	第二批次	第三批次	均值	排放限值
烟气温度（℃）		14.1	13.7	13.4	13.7	/
标态烟气量（Nm³/h）		2080	2044	2009	2044	/
氯化氢	排放浓度(mg/m³)	0.47	0.31	0.53	0.44	10
	排放速率（kg/h）	9.0×10 ⁻⁴				/
备注	1、排气筒高度由受检单位提供。 2、排放限值：《半导体行业污染物排放标准》（DB32/3747-2020）表 3 限值。					

表 1-11 固定污染源废气检测结果表（2 月 20 日）

点位名称		FQ-021 废气排气筒		排气筒高度（m）		25
净化设施		碱喷淋				
检测项目		第一批次	第二批次	第三批次	均值	排放限值
烟气温度（℃）		13.1	13.8	14.0	13.6	/
标态烟气量（Nm³/h）		7622	7578	7743	7648	/
氯化氢	排放浓度(mg/m³)	0.25	0.33	1.25	0.61	10
	排放速率（kg/h）	4.7×10 ⁻³				/
备注	1、排气筒高度由受检单位提供。 2、排放限值：《半导体行业污染物排放标准》（DB32/3747-2020）表 3 限值。					

表 1-12 固定污染源废气检测结果表（2 月 21 日）

点位名称		FQ-001 废气排气筒		排气筒高度（m）		33.5
净化设施		碱喷淋				
检测项目		第一批次	第二批次	第三批次	均值	排放限值
烟气温度（℃）		15.9	16.2	16.4	16.2	/
标态烟气量（Nm³/h）		47280	48929	49269	48493	/
硫酸雾	排放浓度（mg/m³）	ND	ND	ND	ND	5.0
	排放速率（kg/h）	/				/
氯化氢	排放浓度（mg/m³）	ND	0.86	0.33	0.43	10
	排放速率（kg/h）	0.021				/
氮氧化物	排放浓度（mg/m³）	ND	ND	ND	ND	50
	排放速率（kg/h）	/				/
备注	1、排气筒高度由受检单位提供。 2、排放限值：《半导体行业污染物排放标准》（DB32/3747-2020）表 3 限值。 3、“ND”表示未检出，硫酸雾的检出限为 0.2mg/m³（采样体积以 400L 计），氯化氢的检出限为 0.2mg/m³（采样体积以 10L 计），氮氧化物的检出限为 3mg/m³。					

表 1-13 固定污染源废气检测结果表（2 月 21 日）

点位名称		FQ-001 废气排气筒		排气筒高度（m）		33.5
净化设施		碱喷淋				
检测项目		第一批次	第二批次	第三批次	均值	排放限值
烟气温度（℃）		16.5	17.0	17.0	16.8	/
标态烟气量（Nm³/h）		49433	49118	49149	49233	/
氟化物	排放浓度(mg/m³)	ND	ND	ND	ND	1.5
	排放速率（kg/h）	/				/
备注	1、排气筒高度由受检单位提供。 2、排放限值：《半导体行业污染物排放标准》（DB32/3747-2020）表 3 限值。 3、“ND”表示未检出，氟化物的检出限为 0.06mg/m³（采样体积以 150L 计）。					

表 1-14 固定污染源废气检测结果表（2 月 21 日）

点位名称		FQ-001 废气排气筒		排气筒高度（m）		33.5
净化设施		碱喷淋				
检测项目		第一批次	第二批次	第三批次	均值	排放限值
烟气温度（℃）		15.9	16.4	17.0	16.4	/
标态烟气量（Nm³/h）		47280	49269	49149	48566	/
氯气	排放浓度(mg/m³)	ND	ND	ND	ND	5.0
	排放速率（kg/h）	/				/
备注	1、排气筒高度由受检单位提供。 2、排放限值：《半导体行业污染物排放标准》（DB32/3747-2020）表 3 限值。 3、“ND”表示未检出，氯气的检出限为 0.2mg/m³（采样体积以 5L 计）。 4、氯气均值为三小时均值。					

表 1-15 固定污染源废气检测结果表（2 月 21 日）

点位名称		FQ-002 废气排气筒		排气筒高度（m）		33.5
净化设施		碱喷淋				
检测项目		第一批次	第二批次	第三批次	均值	排放限值
烟气温度（℃）		17.1	17.3	17.5	17.3	/
标态烟气量（Nm³/h）		29739	31297	28229	29755	/
硫酸雾	排放浓度(mg/m³)	ND	ND	ND	ND	5.0
	排放速率（kg/h）	/				/
备注	1、排气筒高度由受检单位提供。 2、排放限值：《半导体行业污染物排放标准》（DB32/3747-2020）表 3 限值。 3、“ND”表示未检出，硫酸雾的检出限为 0.2mg/m³（采样体积以 400L 计）。					

表 1-16 固定污染源废气检测结果表（2 月 21 日）

点位名称		FQ-002 废气排气筒		排气筒高度（m）		33.5
净化设施		碱喷淋				
检测项目		第一批次	第二批次	第三批次	均值	排放限值
烟气温度（℃）		17.7	17.8	17.7	17.7	/
标态烟气量（Nm³/h）		28613	28617	28747	28659	/
氟化物	排放浓度(mg/m³)	ND	ND	ND	ND	1.5
	排放速率（kg/h）	/				/
氯化氢	排放浓度(mg/m³)	0.23	0.35	0.30	0.29	10
	排放速率（kg/h）	8.3×10 ⁻³				/
氮氧化物	排放浓度(mg/m³)	ND	ND	ND	ND	50
	排放速率（kg/h）	/				/
备注	1、排气筒高度由受检单位提供。 2、排放限值：《半导体行业污染物排放标准》（DB32/3747-2020）表 3 限值。 3、“ND”表示未检出，氟化物的检出限为 0.06mg/m³（采样体积以 150L 计），氮氧化物的检出限为 3mg/m³。					

表 1-17 固定污染源废气检测结果表（2 月 21 日）

点位名称		FQ-002 废气排气筒		排气筒高度（m）		33.5
净化设施		碱喷淋				
检测项目		第一批次	第二批次	第三批次	均值	排放限值
烟气温度（℃）		17.1	17.7	17.7	17.5	/
标态烟气量（Nm³/h）		29739	28613	28747	29033	/
氯气	排放浓度(mg/m³)	ND	ND	ND	ND	5.0
	排放速率（kg/h）	/				/
备注	1、排气筒高度由受检单位提供。 2、排放限值：《半导体行业污染物排放标准》（DB32/3747-2020）表 3 限值。 3、“ND”表示未检出，氯气的检出限为 0.2mg/m³（采样体积以 5L 计）。 4、氯气均值为三小时均值。					

表 1-18 固定污染源废气检测结果表（2 月 21 日）

点位名称		FQ-003 废气排气筒		排气筒高度（m）		33.5
净化设施		碱喷淋				
检测项目		第一批次	第二批次	第三批次	均值	排放限值
烟气温度（℃）		16.3	16.1	15.9	16.1	/
标态烟气量（Nm³/h）		48699	49104	49307	49037	/
硫酸雾	排放浓度(mg/m³)	ND	ND	ND	ND	5.0
	排放速率（kg/h）	/				/
氯化氢	排放浓度(mg/m³)	0.44	0.49	1.00	0.64	10
	排放速率（kg/h）	0.031				/
氮氧化物	排放浓度(mg/m³)	ND	ND	7	3	50
	排放速率（kg/h）	0.15				/
备注	1、排气筒高度由受检单位提供。 2、排放限值：《半导体行业污染物排放标准》（DB32/3747-2020）表 3 限值。 3、“ND”表示未检出，硫酸雾的检出限为 0.2mg/m³（采样体积以 400L 计），氮氧化物的检出限为 3mg/m³。					

表 1-19 固定污染源废气检测结果表（2 月 21 日）

点位名称		FQ-003 废气排气筒		排气筒高度（m）		33.5
净化设施		碱喷淋				
检测项目		第一批次	第二批次	第三批次	均值	排放限值
烟气温度（℃）		16.2	15.8	15.6	15.9	/
标态烟气量（Nm³/h）		49661	50173	50743	50192	/
氟化物	排放浓度(mg/m³)	ND	ND	ND	ND	1.5
	排放速率（kg/h）	/				/
备注	1、排气筒高度由受检单位提供。 2、排放限值：《半导体行业污染物排放标准》（DB32/3747-2020）表 3 限值。 3、“ND”表示未检出，氟化物的检出限为 0.06mg/m³（采样体积以 150L 计）。					

表 1-20 固定污染源废气检测结果表（2 月 21 日）

点位名称		FQ-003 废气排气筒		排气筒高度（m）		33.5
净化设施		碱喷淋				
检测项目		第一批次	第二批次	第三批次	均值	排放限值
烟气温度（℃）		16.3	15.9	15.6	15.9	/
标态烟气量（Nm³/h）		48699	49307	50743	49583	/
氯气	排放浓度(mg/m³)	ND	0.2	0.4	0.2	5.0
	排放速率（kg/h）	9.9×10 ⁻³				/
备注	1、排气筒高度由受检单位提供。 2、排放限值：《半导体行业污染物排放标准》（DB32/3747-2020）表 3 限值。 3、“ND”表示未检出，氯气的检出限为 0.2mg/m³（采样体积以 5L 计）。 4、氯气均值为三小时均值。					

表 1-21 固定污染源废气检测结果表（2 月 21 日）

点位名称		FQ-004 废气排气筒		排气筒高度（m）		33.5
净化设施		碱喷淋				
检测项目		第一批次	第二批次	第三批次	均值	排放限值
烟气温度（℃）		18.1	18.0	18.0	18.0	/
标态烟气量（Nm³/h）		41388	41957	42399	41915	/
硫酸雾	排放浓度(mg/m³)	ND	ND	ND	ND	5.0
	排放速率（kg/h）	/				/
氯化氢	排放浓度(mg/m³)	1.67	0.25	0.45	0.79	10
	排放速率（kg/h）	0.033				/
备注	1、排气筒高度由受检单位提供。 2、排放限值：《半导体行业污染物排放标准》（DB32/3747-2020）表 3 限值。 3、“ND”表示未检出，硫酸雾的检出限为 0.2mg/m³（采样体积以 400L 计）。					

表 1-22 固定污染源废气检测结果表（2 月 21 日）

点位名称		FQ-004 废气排气筒		排气筒高度（m）		33.5
净化设施		碱喷淋				
检测项目		第一批次	第二批次	第三批次	均值	排放限值
烟气温度（℃）		17.9	17.9	18.0	17.9	/
标态烟气量（Nm³/h）		42439	42475	42387	42434	/
氟化物	排放浓度(mg/m³)	ND	ND	ND	ND	1.5
	排放速率（kg/h）	/				/
氮氧化物	排放浓度(mg/m³)	ND	ND	ND	ND	50
	排放速率（kg/h）	/				/
备注	1、排气筒高度由受检单位提供。 2、排放限值：《半导体行业污染物排放标准》（DB32/3747-2020）表 3 限值。 3、“ND”表示未检出，氟化物的检出限为 0.06mg/m³（采样体积以 150L 计），氮氧化物的检出限为 3mg/m³。					

表 1-23 固定污染源废气检测结果表（2 月 21 日）

点位名称		FQ-004 废气排气筒		排气筒高度（m）		33.5
净化设施		碱喷淋				
检测项目		第一批次	第二批次	第三批次	均值	排放限值
烟气温度（℃）		18.1	17.9	18.0	18.0	/
标态烟气量（Nm³/h）		41388	42439	42387	42071	/
氯气	排放浓度(mg/m³)	ND	0.4	ND	0.2	5.0
	排放速率（kg/h）	8.4×10 ⁻³				/
备注	1、排气筒高度由受检单位提供。 2、排放限值：《半导体行业污染物排放标准》（DB32/3747-2020）表 3 限值。 3、“ND”表示未检出，氯气的检出限为 0.2mg/m³（采样体积以 5L 计）。 4、氯气均值为三小时均值。					

表 1-24 固定污染源废气检测结果表（2 月 21 日）

点位名称		FQ-006 废气排气筒		排气筒高度（m）		33.5
净化设施		酸喷淋				
检测项目		第一批次	第二批次	第三批次	均值	排放限值
烟气温度（℃）		14.1	15.3	16.4	15.3	/
标态烟气量（Nm³/h）		13004	13146	13352	13167	/
氨	排放浓度(mg/m³)	ND	ND	ND	ND	10
	排放速率（kg/h）	/				/
备注	1、排放限值：《半导体行业污染物排放标准》（DB32/3747-2020）表 3 限值。 2、“ND”表示未检出，氨的检出限为 0.25mg/m³（采样体积以 10L 计）。 3、排气筒高度由受检单位提供。					

表 1-25 固定污染源废气检测结果表（2 月 21 日）

点位名称		FQ-005 废气排气筒		排气筒高度（m）		33.5
净化设施		酸喷淋				
检测项目		第一批次	第二批次	第三批次	均值	排放限值
烟气温度（℃）		15.8	16.3	16.8	16.3	/
标态烟气量（Nm³/h）		13684	13635	13063	13461	/
氨	排放浓度(mg/m³)	ND	ND	ND	ND	10
	排放速率（kg/h）	/				/
备注	1、排放限值：《半导体行业污染物排放标准》（DB32/3747-2020）表 3 限值。 2、“ND”表示未检出，氨的检出限为 0.25mg/m³（采样体积以 10L 计）。 3、排气筒高度由受检单位提供。					

表 1-26 固定污染源废气检测结果表（2 月 21 日）

点位名称		FQ-011 废气排气筒		排气筒高度（m）		33.5
净化设施		酸喷淋				
检测项目		第一批次	第二批次	第三批次	均值	排放限值
烟气温度（℃）		17.3	17.5	17.5	17.4	/
标态烟气量（Nm³/h）		14326	14611	14858	14598	/
氨	排放浓度(mg/m³)	ND	ND	ND	ND	10
	排放速率（kg/h）	/				/
备注	1、排放限值：《半导体行业污染物排放标准》（DB32/3747-2020）表 3 限值。 2、“ND”表示未检出，氨的检出限为 0.25mg/m³（采样体积以 10L 计）。 3、排气筒高度由受检单位提供。					

表 1-27 固定污染源废气检测结果表（2 月 25 日）

点位名称		FQ-012 废气排气筒		排气筒高度（m）		33.5
净化设施		碱喷淋				
检测项目		第一批次	第二批次	第三批次	均值	排放限值
烟气温度（℃）		15.5	15.5	15.5	15.5	/
标态烟气量（Nm³/h）		28220	28129	27101	27817	/
硫酸雾	排放浓度（mg/m³）	ND	0.22	ND	ND	5.0
	排放速率（kg/h）	/				/
氯化氢	排放浓度（mg/m³）	ND	ND	1.17	0.46	10
	排放速率（kg/h）	0.013				/
氮氧化物	排放浓度（mg/m³）	ND	ND	ND	ND	50
	排放速率（kg/h）	/				/
备注	1、排气筒高度由受检单位提供。 2、排放限值：《半导体行业污染物排放标准》（DB32/3747-2020）表 3 限值。 3、“ND”表示未检出，硫酸雾的检出限为 0.2mg/m³（采样体积以 400L 计），氯化氢的检出限为 0.2mg/m³（采样体积以 10L 计），氮氧化物的检出限为 3mg/m³。					

表 1-28 固定污染源废气检测结果表（2 月 25 日）

点位名称		FQ-012 废气排气筒		排气筒高度（m）		33.5
净化设施		碱喷淋				
检测项目		第一批次	第二批次	第三批次	均值	排放限值
烟气温度（℃）		15.5	15.5	15.5	15.5	/
标态烟气量（Nm³/h）		28538	28220	28326	28361	/
氟化物	排放浓度(mg/m³)	ND	ND	ND	ND	1.5
	排放速率（kg/h）	/				/
备注	1、排气筒高度由受检单位提供。 2、排放限值：《半导体行业污染物排放标准》（DB32/3747-2020）表 3 限值。 3、“ND”表示未检出，氟化物的检出限为 0.06mg/m³（采样体积以 150L 计）。					

表 1-29 固定污染源废气检测结果表（2 月 25 日）

点位名称		FQ-012 废气排气筒		排气筒高度（m）		33.5
净化设施		碱喷淋				
检测项目		第一批次	第二批次	第三批次	均值	排放限值
烟气温度（℃）		15.5	15.5	15.5	15.5	/
标态烟气量（Nm³/h）		28220	28538	28326	28361	/
氯气	排放浓度(mg/m³)	ND	ND	ND	ND	5.0
	排放速率（kg/h）	/				/
备注	1、排气筒高度由受检单位提供。 2、排放限值：《半导体行业污染物排放标准》（DB32/3747-2020）表 3 限值。 3、“ND”表示未检出，氯气的检出限为 0.2mg/m³（采样体积以 5L 计）。 4、氯气均值为三小时均值。					

表 1-30 固定污染源废气检测结果表（2 月 26 日）

点位名称		FQ-013 废气排气筒		排气筒高度（m）		33.5
净化设施		碱喷淋				
检测项目		第一批次	第二批次	第三批次	均值	排放限值
烟气温度（℃）		17.2	17.0	17.0	17.1	/
标态烟气量（Nm³/h）		28677	29738	30527	29647	/
硫酸雾	排放浓度(mg/m³)	ND	ND	ND	ND	5.0
	排放速率（kg/h）	/				/
氯化氢	排放浓度(mg/m³)	0.22	0.52	0.52	0.42	10
	排放速率（kg/h）	0.012				/
氮氧化物	排放浓度(mg/m³)	ND	ND	ND	ND	50
	排放速率（kg/h）	/				/
备注	1、排气筒高度由受检单位提供。 2、排放限值：《半导体行业污染物排放标准》（DB32/3747-2020）表 3 限值。 3、“ND”表示未检出，硫酸雾的检出限为 0.2mg/m³（采样体积以 400L 计），氮氧化物的检出限为 3mg/m³。					

表 1-31 固定污染源废气检测结果表（2 月 26 日）

点位名称		FQ-013 废气排气筒		排气筒高度（m）		33.5
净化设施		碱喷淋				
检测项目		第一批次	第二批次	第三批次	均值	排放限值
烟气温度（℃）		16.9	17.0	16.8	16.9	/
标态烟气量（Nm³/h）		28223	28563	28790	28525	/
氟化物	排放浓度(mg/m³)	ND	ND	ND	ND	1.5
	排放速率（kg/h）	/				/
备注	1、排气筒高度由受检单位提供。 2、排放限值：《半导体行业污染物排放标准》（DB32/3747-2020）表 3 限值。 3、“ND”表示未检出，氟化物的检出限为 0.06mg/m³（采样体积以 150L 计）。					

表 1-32 固定污染源废气检测结果表（2 月 26 日）

点位名称		FQ-013 废气排气筒		排气筒高度（m）		33.5
净化设施		碱喷淋				
检测项目		第一批次	第二批次	第三批次	均值	排放限值
烟气温度（℃）		17.2	17.0	16.8	17.0	/
标态烟气量（Nm³/h）		28677	30527	28790	29331	/
氯气	排放浓度(mg/m³)	ND	ND	ND	ND	5.0
	排放速率（kg/h）	/				/
备注	1、排气筒高度由受检单位提供。 2、排放限值：《半导体行业污染物排放标准》（DB32/3747-2020）表 3 限值。 3、“ND”表示未检出，氯气的检出限为 0.2mg/m³（采样体积以 5L 计）。 4、氯气均值为三小时均值。					

表 1-33 固定污染源废气检测结果表（2 月 27 日）

点位名称		FQ-014 废气排气筒		排气筒高度（m）		33.5
净化设施		碱喷淋				
检测项目		第一批次	第二批次	第三批次	均值	排放限值
烟气温度（℃）		16.8	16.9	17.1	16.9	/
标态烟气量（Nm³/h）		26372	27392	28352	27372	/
硫酸雾	排放浓度(mg/m³)	ND	ND	ND	ND	5.0
	排放速率（kg/h）	/				/
氯化氢	排放浓度(mg/m³)	0.36	3.36	0.29	1.34	10
	排放速率（kg/h）	0.037				/
氮氧化物	排放浓度(mg/m³)	ND	ND	ND	ND	50
	排放速率（kg/h）	/				/
备注	1、排气筒高度由受检单位提供。 2、排放限值：《半导体行业污染物排放标准》（DB32/3747-2020）表 3 限值。 3、“ND”表示未检出，硫酸雾的检出限为 0.2mg/m³（采样体积以 400L 计），氮氧化物的检出限为 3mg/m³。					

表 1-34 固定污染源废气检测结果表（2 月 27 日）

点位名称		FQ-014 废气排气筒		排气筒高度（m）		33.5
净化设施		碱喷淋				
检测项目		第一批次	第二批次	第三批次	均值	排放限值
烟气温度（℃）		17.0	16.8	16.7	16.8	/
标态烟气量（Nm³/h）		28269	27926	28211	28135	/
氟化物	排放浓度(mg/m³)	ND	ND	ND	ND	1.5
	排放速率（kg/h）	/				/
备注	1、排气筒高度由受检单位提供。 2、排放限值：《半导体行业污染物排放标准》（DB32/3747-2020）表 3 限值。 3、“ND”表示未检出，氟化物的检出限为 0.06mg/m³（采样体积以 150L 计）。					

表 1-35 固定污染源废气检测结果表（2 月 27 日）

点位名称		FQ-014 废气排气筒		排气筒高度（m）		33.5
净化设施		碱喷淋				
检测项目		第一批次	第二批次	第三批次	均值	排放限值
烟气温度（℃）		16.8	17.0	16.7	16.8	/
标态烟气量（Nm³/h）		26372	28269	28211	27617	/
氯气	排放浓度(mg/m³)	ND	ND	ND	ND	5.0
	排放速率（kg/h）	/				/
备注	1、排气筒高度由受检单位提供。 2、排放限值：《半导体行业污染物排放标准》（DB32/3747-2020）表 3 限值。 3、“ND”表示未检出，氯气的检出限为 0.2mg/m³（采样体积以 5L 计）。 4、氯气均值为三小时均值。					

表 1-36 固定污染源废气检测结果表（2 月 27 日）

点位名称		FQ-015 废气排气筒		排气筒高度（m）		33.5
净化设施		碱喷淋				
检测项目		第一批次	第二批次	第三批次	均值	排放限值
烟气温度（℃）		16.8	16.9	17.1	16.9	/
标态烟气量（Nm³/h）		28104	26821	26348	27091	/
硫酸雾	排放浓度(mg/m³)	ND	ND	ND	ND	5.0
	排放速率（kg/h）	/				/
备注	1、排气筒高度由受检单位提供。 2、排放限值：《半导体行业污染物排放标准》（DB32/3747-2020）表 3 限值。 3、“ND”表示未检出，硫酸雾的检出限为 0.2mg/m³（采样体积以 400L 计）。					

表 1-37 固定污染源废气检测结果表（2 月 27 日）

点位名称		FQ-015 废气排气筒		排气筒高度（m）		33.5
净化设施		碱喷淋				
检测项目		第一批次	第二批次	第三批次	均值	排放限值
烟气温度（℃）		16.7	16.7	16.8	16.7	/
标态烟气量（Nm³/h）		25529	25995	26309	25944	/
氟化物	排放浓度(mg/m³)	ND	ND	ND	ND	1.5
	排放速率（kg/h）	/				/
氯化氢	排放浓度(mg/m³)	0.46	0.25	0.53	0.41	10
	排放速率（kg/h）	0.011				/
氮氧化物	排放浓度(mg/m³)	ND	ND	ND	ND	50
	排放速率（kg/h）	/				/
备注	1、排气筒高度由受检单位提供。 2、排放限值：《半导体行业污染物排放标准》（DB32/3747-2020）表 3 限值。 3、“ND”表示未检出，氟化物的检出限为 0.06mg/m³（采样体积以 150L 计），氮氧化物的检出限为 3mg/m³。					

表 1-38 固定污染源废气检测结果表（2 月 27 日）

点位名称		FQ-015 废气排气筒		排气筒高度（m）		33.5
净化设施		碱喷淋				
检测项目		第一批次	第二批次	第三批次	均值	排放限值
烟气温度（℃）		16.8	16.7	16.8	16.8	/
标态烟气量（Nm³/h）		28104	25529	26309	26647	/
氯气	排放浓度(mg/m³)	ND	ND	ND	ND	5.0
	排放速率（kg/h）	/				/
备注	1、排气筒高度由受检单位提供。 2、排放限值：《半导体行业污染物排放标准》（DB32/3747-2020）表 3 限值。 3、“ND”表示未检出，氯气的检出限为 0.2mg/m³（采样体积以 5L 计）。 4、氯气均值为三小时均值。					

表 2 检测依据表

检测项目	检测依据
有组织废气	
氟化物	《大气固定污染源 氟化物的测定 离子选择电极法》（HJ/T 67-2001）
氯化氢	《环境空气和废气 氯化氢的测定 离子色谱法》（HJ 549-2016）
硫酸雾	《固定污染源废气 硫酸雾的测定 离子色谱法》（HJ 544-2016）
氮氧化物	《固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法》（HJ 693-2014）
氯气	《固定污染源排气中氯气的测定 甲基橙分光光度法》（HJ/T 30-1999）
氨	《环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法》（HJ 533-2009）
臭气浓度	《环境空气和废气 臭气的测定 三点比较式臭袋法》（HJ 1262-2022）
硫化氢	《空气和废气监测分析方法》(第四版增补版) 国家环保总局 2007 年 第五篇第四章 十（三）
备注	/

表 3 仪器一览表

仪器编号	仪器名称	仪器型号
X-015-12	自动烟尘(气) 测试仪	崂应 3012H
X-016-26	智能双路烟气采样器	崂应 3072
F-001-14	紫外-可见分光光度计	TU-1810PC
F-010-08	离子色谱仪	883
F-014-12	离子计	PXSJ-216F
X-016-42	全自动烟气采样器	MH3001
F-010-19	离子色谱仪	ECO IC
X-016-19	智能双路烟气采样器	崂应 3072
X-015-38	自动烟尘(气) 测试仪	崂应 3012H
X-060-90	充电便携采气桶	labtm009 AK
X-015-103	阻容法烟气含湿量多功能检测器	1062D 型
X-015-26	自动烟尘(气) 测试仪	崂应 3012H
X-016-10	智能双路烟气采样器	崂应 3072
X-016-40	全自动烟气采样器	MH3001
X-016-20	智能双路烟气采样器	崂应 3072
F-001-13	紫外-可见分光光度计	TU-1810PC
X-046-12	数字温度表	6801
F-014-22	离子计	PXSJ-216
X-016-38	全自动烟气采样器	MH3001
X-016-36	全自动烟气采样器	MH3001
F-010-06	离子色谱仪	883
F-010-21	离子色谱	ECO IC
X-016-21	智能双路烟气采样器	崂应 3072
X-015-08	自动烟尘(气) 测试仪	崂应 3012H
X-015-78	自动烟尘(气)测试仪	崂应 3012H

*****报告结束*****